明石工業高等専門学校	開講年度	平成31年度 (2019年度)	授業科目	知的財産権

科目基礎情報

科目番号	0040	科目区分	専門 / 必修
授業形態	講義	単位の種別と単位数	履修単位: 1
開設学科	電気情報工学科（電気電子工学コース）	対象学年	5
開設期	前期	週時間数	2
教科書/教材	産業財産権標準テキスト総合編第５版（発明推進協会）[参考文献は講義中にて紹介する]		
担当教員	森定 勇二		

到達目標

①わが国及びわが国以外（国際・外国）の知的財産権の制度を理解し、他者に説明できる。
②大学内又は企業内で研究・開発担当者となった場合に、組織内で適切な知財管理能力を発揮できる知識を身につけるとともに、組織内で主導できる。
③出願手続き（国内及び外国）の流れを理解し、弁理士あるいは特許庁（関係機関）とのコミュニケーションの際、どの段階の手続きであるかを理解できる。
④調査の重要性を理解し、自らすべての調査をおこなうべきかそれとも専門家に依頼すべきかの判断ができる。
⑤自らが必要な調査ができるコンピュータリテラシーを獲得し、実際に実行できる。

ルーブリック

	理想的な到達レベルの目安	標準的な到達レベルの目安	未到達レベルの目安
評価項目1	わが国及びわが国以外の知的財産制度を理解し、他者に説明できる。	わが国の知的財産権の制度を理解し、他者に説明できる。	わが国及び外国の知的財産権の制度を他者に説明できない
評価項目2	組織内で適切な知財管理能力を発揮できる知識を身につけるとともに、組織内で主導できる。	組織内で適切な知財管理能力を発揮できる知識について説明できる	組織内で適切な知財管理能力を発揮できる知識について説明できない。
評価項目3	出願手続きの流れを理解し、弁理士あるいは特許庁とのコミュニケーションの際、どの段階の手続きであるかを理解できる。	出願手続きの流れを理解できる。	出願手続きの流れを理解できない
評価項目4	調査の重要性を理解し、自らすべての調査をおこなうべきかそれとも専門家に依頼すべきかの判断ができる。	調査の重要性を理解し、調査の必要性の判断ができる。	調査の重要性を理解できない
評価項目5	自らが調査を行う際に必要なコンピュータリテラシーを用いて，実際に調査できる	自らが調査を行う際に必要なコンピュータリテラシーについて説明できる	自らが調査を行う際に必要なコンピュータリテラシーを獲得できない

学科の到達目標項目との関係

学習・教育到達度目標 (A) 学習・教育到達度目標 (D)

教育方法等

概要	①知的財産権基礎理論(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・その他) ②研究者・開発者の知的財産管理方法論(特許権を中心とする) ③出願手続きフロー等(出願から登録まで及び登録後の流れを解説) ④国際出願手続きのフロー等（PCT国際特許出願制度を中心に各機関と出願後の流れについて解説） ⑤知的財産権の調査関連：講義及び実習（特許・実用新案・意匠・商標の調査の目的、調査ツールについて解説。インターネット経由のJ-PlatPatを利用して検索実習も行う予定） なお、本科目は、知的財産権全般に関する手続きおよび相談業務に従事した経験を有する者が、その経験を活かして授業を行う。
授業の進め方・方法	特許，意匠，著作権などについて講義する. 授業は講義を中心として進めながら，適宜，パソコンによる調査実習等を行う.
注意点	自分自身又は友人・知人等が研究開発した創作（発明等）があると仮定し、その創作を如何に保護するか及び権利化を図るかという臨場感を持って講義に臨んで欲しい。日頃から知的財産権関係のニュースなどに関心を持ち考える習慣を身につけること。 合格の対象としない欠席条件(割合)　1/3以上の欠課

授業計画

		週	授業内容	週ごとの到達目標
前期	1stQ	1週	知的財産権の概要	知的財産権の概観を理解できる
		2週	特許Ⅰ	特許制度の概要、目的、特許（登録）要件等について理解できる
		3週	特許Ⅱ	新規性及び進歩性の判断のしかたを理解できる
		4週	特許Ⅲ	アイデアから広く・強い特許発明を創作するプロセスについて理解できる
		5週	特許 Ⅳ	手続きの流れ及び職務発明について理解できる
		6週	特許Ⅴ・国際特許出願制度／外国の特許制度	外国に特許出願する必要性等について理解できる
		7週	特許Ⅵ	特許・実用新案の調査方法を理解し、実行できる
		8週	中間試験	
	2ndQ	9週	中間試験の解説及び講評・意匠権Ⅰ	特許・実用新案について理解できる。 意匠登録制度の概観について理解できる
		10週	意匠Ⅱ	意匠登録制度の目的、登録要件、特殊な意匠登録、意匠権の効力等について理解できる
		11週	商標	商標登録制度の目的、登録要件、様々な商標登録等について理解できる
		12週	著作権Ⅰ	著作権法の概要（著作物、著作権・著作者人格権、著作隣接権、二次的著作物、著作権の制限等）について理解できる
		13週	著作権Ⅱ	権利の侵害、知っておきたい著作権Q&Aについて理解できる

		14週	不正競争防止法、地理的表示等	育成者権、不正競争防止法、地理的表示について理解できる
		15週	意匠又は商標の調査 知的財産権のまとめ	意匠又は商標の調査を理解し、実行できる 知的財産権（特・実・意・商・著）相互間の違いについて理解できる
		16週	期末試験	

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

分類		分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週
基礎的能力	工学基礎	技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史	技術者倫理(知的財産、法令順守、持続可能性を含む)および技術史	情報技術の進展が社会に及ぼす影響、個人情報保護法、著作権などの法律について説明できる。	2	前12,前13
				知的財産の社会的意義や重要性の観点から、知的財産に関する基本的な事項を説明できる。	3	前1,前14,前15
				知的財産の獲得などで必要な新規アイデアを生み出す技法などについて説明できる。	3	前4

評価割合

	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	100	0	0	0	0	0	100
基礎的能力	0	0	0	0	0	0	0
専門的能力	100	0	0	0	0	0	100
分野横断的能力	0	0	0	0	0	0	0